

Titelbild

David S. Ginger, Hua Zhang und Chad A. Mirkin*

Dip-Pen-Nanolithographie ermöglicht die schnelle Musterbildung auf Oberflächen auf der Nanometerskala. Das Titelbild verdeutlicht das Prinzip dieser Technik, die Abscheidung von Tintenmolekülen von einer Kraftmikroskopspitze auf ein Substrat. Feynmans 1960 formuliertes Diktum zur Miniaturisierung, in nanometergroßen Lettern im Hintergrund, erweist sich erneut als zutreffend. C. A. Mirkin et al. fassen in einem Aufsatz auf S. 30 ff. den gegenwärtigen Stand der Dip-Pen-Methode zusammen und geben einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

